



儀器設備管理辦法

一、儀器名稱

中文：氧電漿蝕刻系統

英文：O₂ plasma etching system

二、儀器設備廠牌及型號

世欣科技公司, SSI-T902

三、功能說明

利用氣體電漿源對試片進行乾式蝕刻，可調控瓦數為(100 W-500 W)，其可用電漿氣體源為氫氣、氧氣及四氟化碳。

四、自行操作規則

1. 本系人員經過認證之後，即可使用儀器。
2. 儀器為本系公用設備，原則上不開放外系人員使用。若外系人員欲使用此公用儀器，經機台負責教師同意，及機台負責人認證，始可操作儀器。
3. 申請注意事項
請申請人確認於近期（半年）內會使用此機台，並長期使用之狀態下在報名訓練課程。

五、預約及管理辦法

1. 欲取得使用資格需先向機台負責教師提出申請，或由其指定的儀器助教提出申請，領取申請表格，經由儀器助教教學指導，完成訓練且由儀器負責人(或助教)核可認證，即可使用公用儀器。
2. 認證項目為儀器之基本操作，核可認證之後，**1 個**禮拜後儀器負責人(或助教)會將通過認證之名單繳交系辦，系辦將開啟此單機權限，此時使用者(B 級)將可預約使用。
3. 每次預約以小時為單位，以 **2 小時**為限，使用時間過後方可預約下次時間。請於預定使用日前 **1 週**至系辦預約登記，若臨時欲取消預約者需在使用前兩日取消預約。
4. 開放時間：**每周二至四，早上 8:00~晚上 8:00**。
5. 使用儀器請依預定時間確實報到使用，若因故無法依預定時間使用，又無事先預約取消者，停權一個禮拜。

六、罰責

1. 本儀器之使用，只限通過認證者，一經發現無核可認證者使用儀器，將連帶停止其所屬實驗室使用權 **1 個月**。
2. 使用儀器前，需事先預約使用時段。

3. 儀器每次之使用，必須確實填寫儀器使用記錄簿，確認並載明儀器使用前後之狀況。遇有儀器異常狀況，需停止使用、記載、並立刻通知儀器負責人。儀器使用記錄簿需隨時置於儀器旁，不得毀損。
4. 經發現因個人因素造成儀器或其配件如有損毀，需由使用者之實驗室負責賠償。
5. 儀器開機和關機時，請依標準操作流程操作，且於儀器使用完後，保持儀器之清潔和清理操作台面，並將實驗廢棄物帶走。違反規定者，經確認後將由通知日起暫停使用者所有使用權限 **1 個月**。
6. 實驗室內不得攜帶任何食物及飲料進入，第一次予以警告，第二次予以停權 **2 個星期**。

七、聯絡人

機台負責教師：李欣縈 教授(hylee@ee.ncku.edu.tw)

機台負責人：林渝璋 0937768624 (yuchang1988@gmail.com)

八、其它部份，則依本系管理規範為原則。